

低炭素関連装置 運用細目

装置名	精密制御半導体基板アライメント・表面処理及び接合システム
設置場所	早稲田大学ナノ理工学研究機構 1階
装置管理者	水野潤
取扱責任者	笠原崇史（庄子研究室）

1 パワーユーザの必要要件、権限範囲

- (1) パワーユーザとは、装置の停止、立ち上げ、一般管理（記録、備品準備など）等について取扱い責任者と同等の技量を持ち、かつ、精密装置の操作に適した感性、几帳面さを持つ者である。
- (2) パワーユーザは、基本的には各研究室で1名決める。パワーユーザを決めることができない研究室は、他研究室のパワーユーザが兼務しても可（事前に依頼すること）。
- (3) パワーユーザは、取扱責任者の講習を受け、合格した者とする。また、定期的な講習を通して、技量の維持向上を図る。
- (4) パワーユーザは、一般利用者の補助・講習を行う。特に、メインチャンバの大気開放および停電などにおける装置の立ち下げに関しては、パワーユーザのみが行い、一般利用者は操作できない。
- (5) パワーユーザは、接合に関する予備知識が必要である。簡単なトラブルシューティングについてはメーカーと電話で交渉できる能力を要求される。

2 一般利用者の定義について

- (1) 一般利用者はパワーユーザから講習をうけ、合格したのち取扱い責任者が承認した者とし、本定義に従う一般利用者のみ当該装置を利用可とする。
- (2) 一般利用者は、EVG520HE および EVG810LT を当該装置と同等かつ十分に操作できる能力のある者とする。
- (3) 学外からの利用依頼に関する各種事務手続きは、まずナノ理工学研究機構で対応する。

3 利用制限、禁止行為について

- (1) 本装置に入れることができる材料は、無機系の材料とする。アウトガスのある有機系材料はこの装置では利用できない。